



第2回集積化MEMS 技術研究会

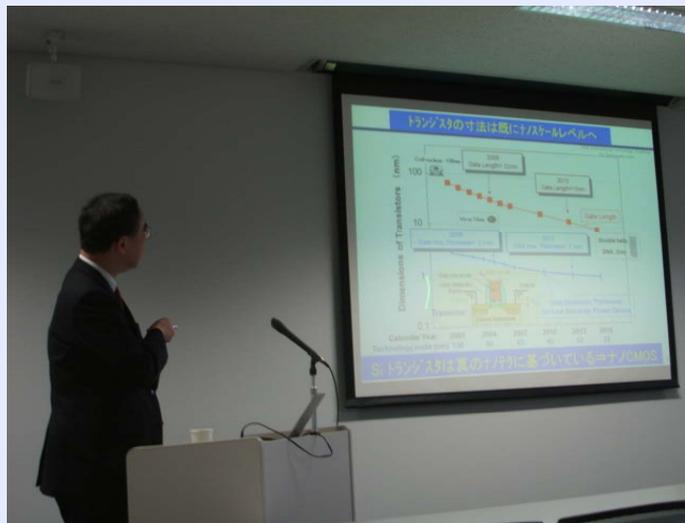
【開催日時】平成20年11月21日(金) 9:30～17:50

【開催会場】東京大学生産技術研究所 An棟4階
中セミナー室 (An-401, An-402)

招待講演 「More than Moore と MEMS」 河村誠一郎 株式会社 半導体先端テクノロジーズ (Selete)



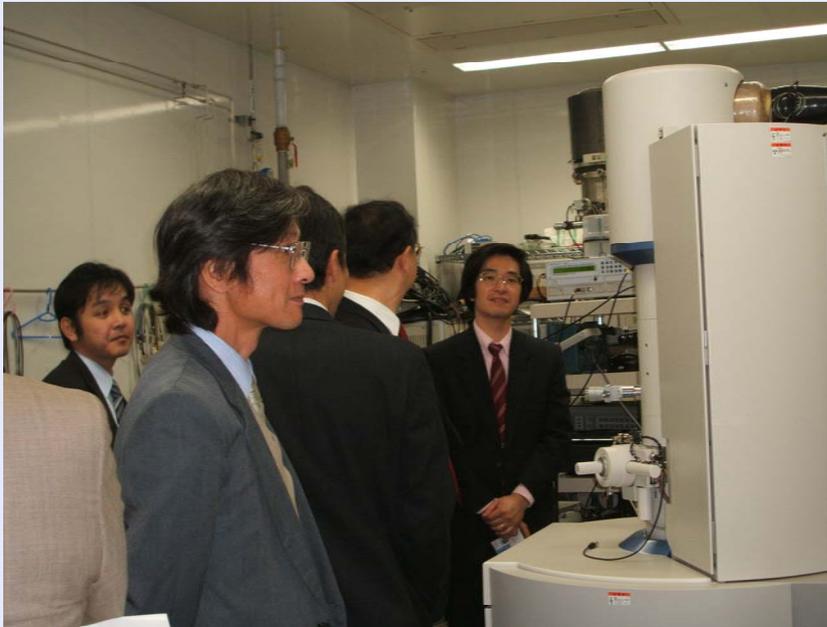
- 内容
1. 「More than Moore」の起源
 2. ナノエレクトロニクス時代の課題
 3. MEMS・NEMS加工技術の国際比較
 4. 欧米のナノエレ研究体制
 5. 世界の主要半導体メーカーの beyond "More Moore" 戦略
 6. 日本のナノエレの研究開発状況
 7. 今後の注目すべき技術の芽
 8. MEMS/NEMSは何を目指すべきか



午前中の公演の様子



MEMS系クリーンルーム見学会



招待講演 「MEMSによる異機能集積プロセス」
藤田博之 東京大学生産技術研究所



午後の発表の様子



午後の発表の様子



午後の発表の様子



午後の発表の様子



午後の発表の様子



懇親会



懇親会 乾杯



懇親会の様子



懇親会の様子



懇親会 閉会

